

DIN EN ISO 25178-604:2013-12 (D)

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - Oberflächenbeschaffenheit: Flächenhaft - Teil 604: Merkmale von berührungslos messenden Geräten (Weißlicht-Interferometrie) (ISO 25178-604:2013); Deutsche Fassung EN ISO 25178-604:2013

| Inhalt | Seite |
|---|-------|
| Vorwort | 3 |
| Einleitung | 4 |
| 1 Anwendungsbereich | 5 |
| 2 Begriffe | 5 |
| 2.1 Begriffe, die sich auf alle flächenhaften Verfahren zur Messung der Oberflächenbeschaffenheit beziehen | 5 |
| 2.2 Begriffe, die sich auf die x- und y-Abtastsysteme beziehen | 11 |
| 2.3 Begriffe, die sich auf optische Systeme beziehen | 12 |
| 2.4 Begriffe, die sich auf die optischen Eigenschaften des Werkstücks beziehen | 14 |
| 2.5 Spezifische Begriffe zur Weißlicht-Interferometrie-Mikroskopie | 15 |
| 3 Beschreibungen der Einflussgrößen | 18 |
| 3.1 Allgemeines | 18 |
| 3.2 Einflussgrößen | 19 |
| Anhang A (informativ) Überblick und Komponenten eines Weißlicht-Interferometrie-Mikroskops (CSI-Mikroskops) | 21 |
| Anhang B (informativ) Theorie der Arbeitsweise der Weißlicht-Interferometrie (CSI) | 26 |
| Anhang C (informativ) Räumliche Auflösung | 34 |
| Anhang D (informativ) Beispielverfahren zur Abschätzung der Wiederholpräzision der Oberflächentopographie | 38 |
| Anhang E (informativ) Zusammenhänge mit dem GPS-Matrix-Modell | 39 |
| Literaturhinweise | 40 |